

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10188280 A

(43) Date of publication of application: 21 . 07 . 98

(51) Int. CI

G11B 7/00

G11B 7/125

G11B 7/24

G11B 19/02

(21) Application number: 08337894

(22) Date of filing: 18 . 12 . 96

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

FURUKAWA MIEKO KASHIHARA TOSHIAKI HORAL KEIICHIRO

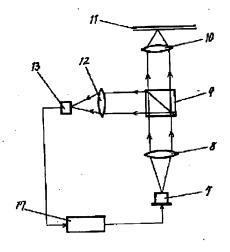
(54) INITIALIZING DEVICE AND INFORMATION RECORDING CARRIER

(57) Abstract: .

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to stably obtain an optical disk which is lessened in the unequal reflectivity of the disk generated from a difference in states according the to crystalline distribution of erasing light by initialization.

SOLUTION: This device is constituted to initialize an recording carrier information investigating the initial state of this carrier and continuously or discontinuously changing either of power or line speed or both thereof according thereto. The device is also constituted to initialize the optical information recording carrier 11 by initializing part of the carrier, investigating the state of the initialized part and continuously or discontinuously changing either of the power or the line speed or both thereof according thereto.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-188280

(43)公開日 平成10年(1998)7月21日

(51) Int. C1. 6	識別記号		FΙ					
G11B	7/00		G 1 1 B	7/00		F		
						L		
	7/125			7/125		С		
	7/24			7/24				
	19/02 5 0 1			19/02	501	P		
	審査請求 未請求	請求項の数7	OL			(全7]	頁)	
(21)出願番号	特願平8-337894		(71)出願人	000005821				
	,			松下電	器産業株	式会社		
· (22)出願日	平成8年(1996)12月		大阪府	門真市大	字門真	1006番地		
			(72)発明者	古川	美恵子		-	
				大阪府	門真市大	字門真	1006番地	松下電器
				産業株	式会社内			
			(72)発明者	樫原	俊昭			
				大阪府	門真市大	字門真	1006番地	松下電器
				産業株	式会社内			
			(72)発明者	宝来	慶一郎			
				大阪府	門真市大	字門真	1006番地	松下電器
				産業株	式会社内			
		5	(74)代理人	弁理士	滝本	智之	(外1名)	

(54) 【発明の名称】初期化装置及び情報記録担体

(57)【要約】

【課題】 初期化による消去光の強度分布に応じた結晶 状態の差から発生するディスクの反射率むらが少ない光 ディスクを安定に得ることを目的とする。

【解決手段】 光学的情報記録担体 1 1 の初期状態を調べ、それに応じてパワーまたは線速の一方または両方を連続的にまたは不連続に変化させて初期化するようにしたものである。また光学的情報記録担体の一部を初期化して、初期化した部分の状態を調べ、それに応じてパワーまたは線速の一方または両方を連続的にまたは不連続に変化させて初期化するようにしたものである。

7 半導体レーサー

8 コリナートレンズ

6 F.- MY 1,13-

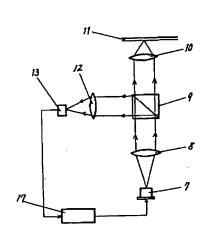
10 対機レンズ

11 7127

12 レンズ

13 パワーモニター

17 レーザーパワーエントロール回路



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも発光部と対物レンズから構成 された光ピックアップと、光ピックアップを径方向に移 動させる手段と、相変化型記録膜を有する光学的情報記 録担体を保持・回転させる機構を有し、前記情報記録担 体に前記光ピックアップからの出射光を照射して情報記 録層の結晶状態を変化させる初期化装置で、前記光学的 情報記録担体の初期状態に応じてパワーまたは線速度の 一方、または両方を連続的または不連続に変化させ、初 期化することを特徴とする初期化装置。

【請求項2】 光学的情報記録担体の初期状態のうち、 反射率または透過率の一方または両方をモニターして初 期化装置のパワーまたは線速度の一方または両方を、前 記反射率または透過率の一方または両方に応じて連続的 または不連続に変化させて、前記情報記録担体を初期化 ····· することを特徴とする請求項1記載の初期化装置。

【請求項3】 少なくとも発光部と対物レンズから構成 された光ピックアップと、光ピックアップを径方向に移 動させる手段と、相変化型記録膜を有する光学的情報記 録担体を保持・回転させる機構を有し、前記情報記録担 20 体に前記光ピックアップからの出射光を照射して情報記 録層の結晶状態を変化させる初期化装置で、前記情報記 録担体の一部を特定条件で初期化し、前記初期化した部 分の状態をモニターして、前記状態に応じたパワーまた は線速度の一方または両方を連続的または不連続に変化 させて、前記情報記録担体の必要な部分を初期化すること とを特徴とする初期化装置。

【請求項4】 光学的情報記録担体の一部をあらかじめ 初期化を行い、その初期化した状態のうち、反射率また は透過率の一方または両方をモニターして前記初期化装 30 置のパワーまたは線速度の一方または両方を、前記反射 率または透過率の一方または両方に応じて連続的または 不連続に変化させて、前記情報記録担体を初期化するこ とを特徴とする請求項3記載の初期化装置。

【請求項5】 光学的情報記録担体の、直接的に情報の 記録、再生あるいは消去に関わらない部分に、初期化に よる反射率の変化を利用して、識別情報を記録すること を特徴とする初期化装置。

【請求項6】 識別情報が、文字、コード情報、符号、 とする請求項4記載の初期化装置。

【請求項7】 請求項1~請求項6のいずれかに記載の 初期化装置で初期化されたことを特徴とする相変化型情 報記録担体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、大容量・高密度記 録を可能にした光ディスクにおいて、その初期化を行う 初期化装置、及び初期化された情報記録媒体に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】少なくとも、光により情報を記録・再生 あるいは消去する光ディスクでは、円盤状の樹脂基盤の 上に誘電体保護層や金属あるいは半金属の記録層などが 蒸着やスパッタ法で積層されており、これらの記録層や 保護層を保護するために樹脂の保護コートが施されてい る。通常、蒸着やスパッタ法で形成される薄膜は、原子 や分子が規則正しく配列していないアモルファス状態に なっている。このアモルファス状態は、溶融状態から急 10 速に冷却され、原子や分子が規則正しく配列する前に固 体として凍結された場合にも実現する。多くの相変化型 のディスクは、結晶状態を初期状態とし、蒸着やスパッ タ法で膜を積層した後に、アモルファスの膜を結晶化さ せる初期化を行う。初期化では、多くは半導体レーザー を光源とし、ディスク面に集光して高温にすることによ り、熱エネルギーを得た原子や分子がよりエネルギー状 態が低い安定な位置に移動して、規則正しく配列した結 晶状態となる。従来の初期化装置では、半導体レーザー の光をディスクの記録層に焦点をあわせて集光し、記録 膜を昇温し、レーザー光をディスクの内周から外周、あ るいは外周から内周と径方向に順次移動させて、必要な 領域の初期化を行っていた。ところで多くの場合、光デ ィスクには、記録・再生あるいは消去に用いる光ディス ク装置のレーザー光が、必要な位置を正しく走行する様 に案内溝が設けてあり、外乱などにより必要な場所から 逸脱しかけた場合、正しい位置に戻すような各種のサー ボ機構が講じてある。これらのサーボ機構は、ディスク からの反射光の変化を信号としている。たとえば、光デ ィスク装置のレーザー光が案内溝上を正しく走行するた めの、トラッキングサーボ機構では、レーザー光が案内 溝の中心から左側、または右側にずれた場合、溝構造に よる光の回折現象により反射光量に変化が生じる。この 反射光量の変化を利用して、変化が生じた場合は即座に 光ディスク装置のレーザー光を正常な位置に戻すような 機構が講じてある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】初期化装置では特定波 長の半導体レーザーを用いているが、複数の膜が積層さ れているディスクでは、各薄膜の膜厚のばらつきや変化 あるいは形状の少なくともいずれかからなることを特徴 40 によりディスクの光学特性が変わる。初期化の際に重要 なのは、初期化前のディスクの、初期化装置で使用して いる半導体レーザーの波長における光の吸収率であり、 同一条件で初期化してもディスクの吸収率が異なると、 光の利用効率が異なることになり、初期化後の状態が大 きく異なることになる。図4に従来の初期化装置の光学 系の例を示す。半導体レーザー7から出射した光をコリ メートレンズ8で平行光に整形し、ピームスプリッター 9で二つの方向に分けられる。ビームスプリッター9を 通過した光は対物レンズ10でディスク11の記録膜上 50 に集光され、ディスク11は初期化される。また、ビー

3

ムスプリッター9で直角方向に曲げられた光は、レンズ 12でパワーモニター13上に集光され、常に同一のパ ワーが半導体レーザー7から出射されるように、レーザ ーパワーコントロール回路17で制御されている。従来 の技術では、吸収率が異なるディスクがあっても同一設 定条件で初期化してしまうため、初期化後のディスクの 特性が異なる光ディスクができてしまうという問題があ った。特に、初期化に用いられるような大出力の半導体 レーザーは、出力光に強度分布があり、強度が強いまた は弱いレーザー光が照射された部分では、局所的にディ 10 スクの特性が他の部分とは大きく異なってしまい、その ようなディスクを光ディスク装置にかけた場合、ビーム をトラックに追従させるためのトラッキングサーボ系が うまく働かず、ディスクの異常と認識してしまうなど、 問題があった。特にディスク上の各薄膜の膜厚が設定値 … からずれて、吸収率が大きく変わった場合、従来の様に 同一条件で初期化してしまうと、光ディスク装置がディ スクの異常と認識するようになり、工程上歩留まりが下 がり、問題であった。

【0004】また、ディスクの識別には、初期化とは別 20 の工程を設け、多くの場合、直接記録や再生や消去に関わらない部分に版やインクジェットなどで生産日や生産ライン、個体の通し番号など必要な情報を記録しており、工程管理上複雑化するという問題があった。

【0005】本発明は、このような初期化装置において、不良品の低減、歩留まり向上を目的とするものである。また、このような初期化装置において、工程の簡素化を目的とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の初期化装置にお 30 いては、光学的情報記録担体の初期状態を調べ、それに応じてパワーまたは線速度の一方または両方を連続的にまたは不連続に変化させて初期化するようにしたものである。

【0007】また光学的情報記録担体の一部を初期化して、初期化した部分の状態を調べ、それに応じてパワーまたは線速度の一方または両方を連続的にまたは不連続に変化させて初期化するようにしたものである。

【0008】また、初期化により反射率が変わることを 利用して、初期化する際に同時に必要な識別情報を記録 40 するようにしたものである。

【0009】この本発明によれば、初期化後のディスクの特性が面内で部分的に大きく異なることのない均一性に優れた光ディスクが得られ、不良率が低減され、歩留まりの向上が図れる。

【0010】また、印字等の工程が、初期化と同時に行え、工程の簡略化が図れる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、少なくとも発光部と対物レンズから構成された光ピ 50

ックアップと、光ピックアップを径方向に移動させる手段と、相変化型記録膜を有する光学的情報記録担体を保持・回転させる機構を有し、情報記録担体に光ピックアップからの出射光を照射して情報記録層の結晶状態を変化させる初期化装置で、光学的情報記録担体の初期状態に応じてパワーまたは線速度の一方、または両方を変化させて初期化することを特徴とするものであり、ディス

スクの特性が面内で大きく異なることのない、均一性に 優れた高性能な光ディスクが、安定に得られるという作 用を有する。

クやディスク上の場所に応じた強さの光または照射時間 でディスクが初期化されることになり、初期化後のディ

【0012】請求項2に記載の発明は、光学的情報記録担体の初期状態のうち、反射率または透過率の一方または両方をモニターして初期化装置のパワーまたは線速度の一方または両方を、反射率または透過率の一方または両方に応じて、連続的または不連続に変化させて、情報記録担体を初期化することを特徴としたものであり、そのディスクの反射率または透過率の一方または両方に応じた強さの光または照射時間でディスクが初期化されることになり、初期化後のディスクの特性が面内で部分的に大きく異なることのない、均一性に優れた高性能な光ディスクが、安定に得られるという作用を有する。

【0013】請求項3に記載の発明は、少なくとも発光部と対物レンズから構成された光ピックアップと、光ピックアップを径方向に移動させる手段と、相変化型記録膜を有する光学的情報記録担体を保持・回転させる機構を有し、情報記録担体に光ピックアップからの出射光を照射して情報記録層の結晶状態を変化させる初期化装置で、情報記録担体の一部を特定条件で初期化し、初期化した部分の状態をモニターして、その状態に応じたパワーまたは線速度の一方または両方を連続的または不連続に変化させて情報記録担体の必要な部分を初期化することを特徴とするものであり、初期化後のディスクの特性面内で大きく異なることのない、均一性に優れた高性能な光ディスクが、安定に得られるという作用を有する。

【0014】請求項4に記載の発明は、光学的情報記録 担体の初期状態のうち、反射率または透過率の一方また は両方をモニターして初期化装置のパワーまたは線速度 の一方または両方を、反射率または透過率の一方または 両方に応じて、連続的または不連続に変化させて、情報 記録担体を初期化することを特徴としたものであり、初 期化後のディスクの特性が面内で大きく異なることのな い、均一性に優れた高性能な光ディスクが、安定に得ら れるという作用を有する。

【0015】請求項5に記載の発明は、光学的情報記録 担体の、直接的に情報の記録、再生あるいは消去に関わ らない部分に、初期化による反射率の変化を利用して、 識別情報を記録することを特徴としたものであり、初期 化と同時に、必要な識別情報を記録するようにしたの

4

で、新たなナンバリングや印字の工程を設けることな く、工程の簡素化が図れるという作用を有する。

【0016】請求項6に記載の発明は、識別情報が、文字、コード情報、符号、あるいは形状の少なくともいずれかからなることを特徴としたものであり、初期化と同時に、必要な識別情報を記録するようにしたので、新たなナンバリングや印字の工程を設けることなく、工程の簡素化が図れるという作用を有する。

【0018】 (実施の形態1) 以下、本発明の実施の形 態1について、図1、図2、図3、図5を用いて説明す る。図1は一般的な4層膜構成の光ディスクの膜構成図 であり、1は基板、2は下誘電体層、3は記録層、4は 上誘電体層、5は反射層、6は樹脂のオーバーコート層 である。また図2に図1における下誘電体層2の膜厚に 対する、波長810nmにおける反射率を示す。波長8 10 n mは、初期化レーザー波長である。このディスク では4層目の反射膜の膜厚が厚いため透過光量はほとん どゼロである。従って、ディスクの波長810nmにお ける吸収率は(100一反射率)%になる。図2に図1 のディスクの下誘電体層2の膜厚が変わった時の、非晶 質状態の反射率を示す。生産中に何らかの理由で、下誘 30 電体層2の膜厚が変化した場合に、図2に示すように、 ディスクの非晶質状態の反射率が変化し、従って、吸収 率も変わる。実際、計測しやすいのは、反射率か透過率 であり、本実施の形態においては、透過光量がほとんど ゼロのため、反射率を計測した。また、図2では下誘電 体層2の膜厚に対する反射率を例として示しているが、 他の記録層3や、上誘電体層4の膜厚が変わっても、反 射率の変化が生じる。また、屈折率などの光学定数が変 化しても、反射率が変化する。このように反射率が変わ ると、吸収率も変わり、即ち光の利用効率が変わる。初 40 期化の条件の主なものは、パワーと線速度と初期化ヘッ ドの送りピッチである。初期化ヘッドの送りピッチは、 初期化装置のヘッドの位置出し精度に関わる部分が大き く、ディスク面において初期化されていない部分が残ら ないことなどに注意して、設定する必要がある。図3

(a) に初期化において線速度を一定に設定した場合の、適正な初期化が行える、ディスクの反射率と初期化パワーとの関係を示す。この関係をもとに、初期化前のディスクの反射率をモニターして、その値に応じて初期化の際のレーザーパワーを適正な値に設定した。また、

図3(b)にパワーを一定にした場合の、適正な初期化 が行えるディスクの反射率と線速度の関係を示す。この 関係を利用して、初期化前のディスクの反射率をモニタ ーして、その値に応じて初期化の際の線速度を適正な値 に設定するようにしてもよい。また、初期化装置には、 レーザーパワー、線速度とも設定可能範囲があるので、 パワーまたは線速度の一方のみで最適条件への設定が不 可能な時は、例えば、まず線速度一定条件でパワーを変 え、そのパワーでさらに線速度を設定するようにしても よい。図5に本実施の形態に用いた反射率モニターを採 用した初期化装置光学系の簡略図を示す。7は半導体レ ーザー、8はコリメートレンズ、9はビームスプリッタ 一、10は対物レンズ、11はディスク、20はレン ズ、18は反射率モニターである。半導体レーザー7か ら出射した光は、コリメートレンズ8で平行光に整形さ れ、ビームスプリッター9を通過し、対物レンズ10で ディスク11の記録膜上に集光される。ディスク11か らの反射光は、対物レンズ10を通過後、ビームスプリ ッター9で直角方向に反射され、レンズ20で反射率モ ニター18上に集光され、その情報が演算回路19に入 る。反射率が高い時は、吸収率が下がるため高パワーが 必要であり、反射率が低い時は、吸収率が増えるので、 投入パワーは小さくてよい。この反射光量の値に応じ て、演算回路19、レーザーパワーコントロール回路1 7を通じて、半導体レーザー7のパワーの調整が行われ る。ディスク11の局所的な反射率の変化に対しては、 演算回路19およびレーザーパワーコントロール回路1 7の時定数を、その変化より大きめに設定しておけばよ い。ディスク11の反射率変動は、膜厚の変化だけでな く、ディスク11上のごみや欠陥、あるいは膜のない部 分にヘッドが暴走した時にも発生する。また、反射率が 高い反射膜がむき出しになっている部分があった時など は、吸収率が減るので、大きなパワーに設定されてしま うことになる。ところで、膜厚変動幅は、成膜装置や膜 厚コントロール性能の実力によって決まり、膜厚変動に 伴う反射率変動幅も決まる。膜厚変動による反射率変動 幅から求められる、初期化パワー設定範囲以上の過大な パワー設定を伴う場合は、除外できるように設定するこ とは、初期化用レーザーを保護する上で重要であり、初 期化装置のパワーの設定値を監視するために、パワーモ ニター13に入射した光の情報も演算回路19に入るよ うにしておくことは有効である。また、レーザーパワー を固定しておいて、ディスク11の反射率の情報をディ スク11の回転を制御するディスク駆動系コントロール 回路(図示せず)に導き、線速度を適正化するように調 整してもよい。また、初期化装置にはレーザーパワー及 び線速度には設定可能範囲が限定されているので、片方 を固定、他方の適正化で条件が出ない場合などは、レー ザーパワーと線速度の両方で適正化を行えるように設定 50 してもよい。初期化前のディスクの状態を決めるのは、

8

反射率でなくともよく、膜構成により透過光量がある場合には透過率をモニターしても良い。また反射率と透過率の両方をモニターして、その値に応じて初期化条件の適正化を行っても良い。また、膜厚により、膜の応力によるディスクのそりなどディスクの機械特性が変化する場合は、その機械特性などをモニターして、初期化の条件の最適化を行ってもよい。また、ディスクの一部を特定条件で初期化し、初期化後の状態をモニターしてその特性がある条件になるように初期化条件を最適化し、必要な領域を初期化するようにしても良い。さらに、ディ 10スク面上で膜厚分布が予測できる場合は、特定部分の反射率や透過率をみて、連続的にまたは不連続に初期化条件を変えてもよい。

7

【0019】 (実施の形態2) 次に本発明の実施の形態 2について図6を用いて説明する。図6 (a) は同心円 ····· 状の識別情報を記録したディスクの外観図を示す。 1 4 が成膜領域、15が初期化領域、16が識別情報であ る。ディスクの成膜領域は、成膜するときのマスクの大 きさで決まる。内周マスクの大きさを小さくして、記録 や再生、消去に関係しない部分に成膜を行い、この部分 20 に、初期化によって反射率が変わることを利用して、目 視で判別可能である、他と区別するための識別情報を記 録した。従って、成膜領域14のうち初期化領域15 は、初期化を行うと、反射率の低い非晶質状態が反射率 の高い結晶状態になり、目視で識別可能となる。初期化 領域15とは別にその内側に、製造ラインの識別が可能は なように製造ライン毎に、半径の異なる同心円環形状の 識別情報16を初期化動作によって記録し、その半径と 数で区別するようにした。識別情報16の周りは、非晶 質状態なので、初期化されて反射率が上がった部分が目 30 視可能な識別情報16となる。本実施の形態では、初期 化の位置設定だけで可能なので、簡単なために、同心円 環形状の位置と本数により識別情報16を表わした。図 6 (b) には文字による識別情報を記録したディスクの 外観図を示す。図6 (b) のように文字や、また符号、 コード情報、数字などをいれ、製造ラインのほか装置情 報や生産時間帯、条件、個体通し番号などの識別情報を 初期化によって記録してもよい。

[0020]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、初期化前 40 のディスクの状態をモニターして初期化条件のパワーや 線速度を設定して初期化することにより、特性のより均 ーなディスクが安定に得られるという有利な効果が得ら

れる。また、ディスクの、記録、再生、消去に関わらない部分の一部を初期化し、初期化後の状態をモニターして初期化条件のパワーや線速度を設定して初期化することにより、特性のさらに均一なディスクが得られるという有利な効果が得られる。さらに、初期化による反射率の変化を利用して、初期化の際に目視可能な識別情報を記録することは、工程の簡素化の面から効果的であるという有利な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

- 0 【図1】4層膜構成の光ディスクの膜構成図
 - 【図2】下誘電体層2の膜厚に対する、反射率のグラフ 【図3】(a)適正な初期化が行える、ディスクの反射 率と初期化パワーのグラフ(線速度一定時)
 - (b) 適正な初期化が行える、ディスクの反射率と初期 化の線速度のグラフ(パワーー定時)
 - 【図4】初期化装置の光学系の簡略図
 - 【図5】反射率モニターを採用した初期化装置光学系の 簡略図
 - 【図 6】 (a) 同心円状の識別情報を記録したディスクの外観図
 - (b) 文字状の識別情報を記録したディスクの外観図 【符号の説明】
 - 1 基板
 - 2 下誘電体層
 - 3 記録層
 - 4 上誘電体層
 - 5 反射層
 - 6 樹脂オーバーコート層
 - 7 半導体レーザー
 - 8 コリメートレンズ
 - 9 ビームスプリッター
 - 10 対物レンズ
 - 11 ディスク
 - 12 レンズ
 - 13 パワーモニター
 - 14 成膜領域
 - 15 初期化領域
 - 16 識別情報
 - 17 レーザーパワーコントロール回路
 - 18 反射率モニター
 - 19 演算回路
 - 20 レンズ

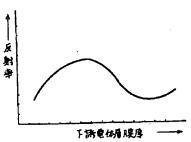
s

【図1】

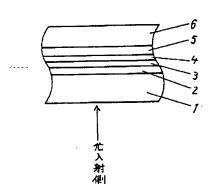
【図2】

【図3】

- 1 基 板 2 下銷电体層
- 3 記錄層
- 4 上訥電体層 5 反射層
- 6 オーバーコート層



(a) NFJ-9-: 總選度 7m/s 行 17 7 6m/s

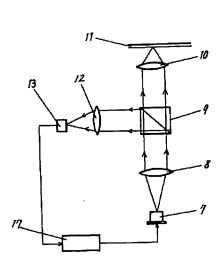


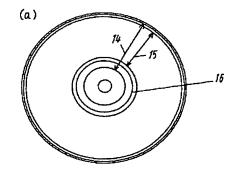
【図4】

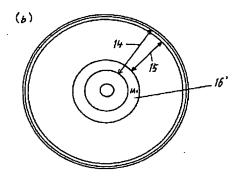
- 7 半導体レーザー
- 8 コリナートレンズ
- 9 4-4779-9-
- 10 対物レンズ
- 11 ディスク
- 12 レンズ
- 13 パワーモニター
- 17 レーサードワーコントロール回路



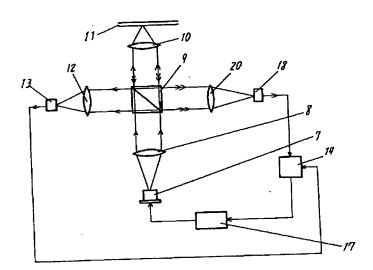
- 4 成膜領域
- 方 初期化領域
- 16,16 識別情報







【図5】



- 19 レーサーパワー コントロール回路
- な 反射率モニター
- 月 漢算回路
- 20 レンズ